

(株)エイエルエステクノロジー

New release !

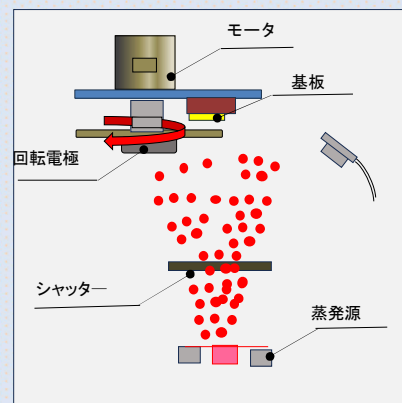
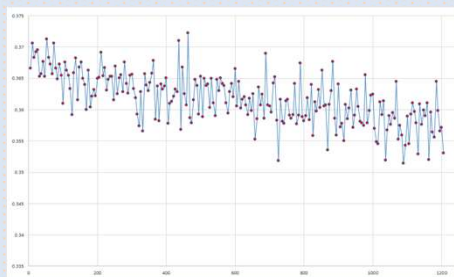
回転型ケルビンプローブシステム RKP-1

仕事関数 & 表面電位の高精度・リアルタイム測定を実現！

主な用途：金属・半導体 清浄表面の仕事関数(フェルミ準位)測定
有機半導体等の表面電位の成膜中リアルタイム測定

- 高精度回転電極による高分解能測定
- 真空対応 ・大気の影響を受けない、安定した計測可能
- 振動型では困難な成膜中の仕事関数 & 表面電位のリアルタイム測定を実現。
- ヘテロ界面でのバンドベンディングや極性分子蒸着膜の配向分極を評価可能
- 簡単操作の計測ソフト。 温度、圧力等のデータ取り込み可

■ 計測基板 10×20mm (計測部10×10mm)



グローブボックス Sagami

コンパクト with 高性能！

- リーズナブルプライス
- 新規開発のコンパクトなガス循環精製器
酸素濃度 ≤ 5PPM / 露点 ≤ 5PPM (-64°C以下)
PLCによる自動再生
- 高い対N₂ガス安全性
・万が一のN₂ガス漏れに対して元栓を自動遮断
・ボックス内部のN₂圧力は自動で制御 (APC)
- ランニングコストの低減
精製剤の交換はお客様ご自身で可能
- 前面樹脂パネル内側は特殊コーティング
耐溶剤性向上、静電防止を実現
- 拡張性
当社および他社製の真空装置にも接続可能
- オプション
VOC (揮発性有機化合物) センサー 等

